【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成21年5月21日(2009.5.21)

【公開番号】特開2009-44755(P2009-44755A)
【公開日】平成21年2月26日(2009.2.26)
【年通号数】公開・登録公報2009-008
【出願番号】特願2008-253515(P2008-253515)
【国際特許分類】
Ｈ０３Ｈ　9/17　(2006.01)
Ｈ０３Ｈ　3/02　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　41/09　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　41/22　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　41/18　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　41/24　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０３Ｈ　9/17　Ｆ
Ｈ０３Ｈ　3/02　Ｂ
Ｈ０１Ｌ　41/08　Ｃ
Ｈ０１Ｌ　41/08　Ｌ
Ｈ０１Ｌ　41/22　Ｚ
Ｈ０１Ｌ　41/18　１０１Ｚ
Ｈ０１Ｌ　41/22　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成21年4月3日(2009.4.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
支持枠と、
支持枠上に積層される圧電体と、
前記圧電体の前記支持枠側の主面に形成される底部電極と、他方の主面に形成される頂部電極とを有し、
前記頂部電極は平面視で方形の頂部電極本体と、前記頂部電極本体の外周の少なくとも対向する二辺の端面部分に形成されている鋸歯形状の電極段部と、を含んでいることを特徴とする圧電薄膜共振子。
【請求項２】
請求項１に記載の圧電薄膜共振子において、
前記頂部電極の前記電極段部が、液滴吐出用導電体材料からなることを特徴とする圧電薄膜共振子。
【請求項３】
請求項２に記載の圧電薄膜共振子において、
前記頂部電極本体は平面視で平行四辺形であることを特徴とする圧電薄膜共振子。
【請求項４】
支持枠と、
支持枠上に積層される圧電体と、

前記圧電体の前記支持枠側の主面に形成される底部電極と、他方の主面に形成される平面視で方形の頂部電極と、を有する圧電薄膜共振子の製造方法であって、

前記頂部電極の頂部電極本体を半導体プロセスにより形成し、前記頂部電極本体の外周の少なくとも対向する二辺の端面部分に液滴吐出法により電極段部を形成することを特徴とする圧電薄膜共振子の製造方法。